生 産 研究



速

UDC 66.06:532.71:666.5

膜構造の精密濾過性能に及ぼす効果

-静電成膜法によるセラミック膜の濾過性能-

Effect of a membrane structure on microfiltration performance

-Microfiltration performance of a ceramic membrane formed by electrostatic method-

野村剛志*·山本英夫* Tsuyoshi NOMURA and Hideo YAMAMOTO

1.緒

懸濁物質を含む溶液濾過では、膜面にケーク層が形成 され、また不可避的な膜の目詰まりを伴う、このため透 過流束が著しく低下するほか,ケーク層が分離機能を 持ってくるため, 膜固有の分画性能が阻害されることに もなる。この現象は膜による水処理、食品加工あるいは 血液濾過など膜の応用に共通する困難な問題であるが、 できるだけ効果的な濾過を行い,処理量を増すためには, 膜モジュールの工夫と運転操作条件の選択が重要となる。 同時に、膜の洗浄による透過流束の回復が不可欠である。

ところで、膜の洗浄にあたっては、膜の表面構造の違 いが洗浄のしやすさに影響するとの指摘があり"、実験 でも膜によって洗浄性に差のでることはよく経験すると ころである。筆者らも膜の構造と洗浄性については興味 を持って注目し、より理想的であると思われる膜の作成 を検討してきた。その結果、静電成膜法3)~5)によるセラ ミック膜の構造がこれにきわめて近いものであると思わ れた. そこで, この膜と従来の膜とを用いて濾過試験を 行い、その結果を比較しつつ洗浄性に優れた膜構造とは どういうものかを検討した。



*東京大学生産技術研究所 第4部

2.膜の構造

静電成膜法による膜の形成についてはすでに報告3)~5) してきたので省略するが、その概略は、気相反応法 (CVD) で生成した直後の微粒子 (0.01~0.5µm) を強制 荷電し、これを直流電界で孔径の大きな多孔質支持体上 に静電沈着させ、この微粒子堆積層をその場で焼結し、 緻密な多孔質薄膜とするものである。微粒子の運動制御 を静電気力で行い、電界中での微粒子の数珠玉形成現象 を利用したものである。このようにして形成した焼結膜 の表面構造の典型的な例を図1に示した。これは非対称 膜の緻密層にあたる部分で、厚さ20~30µm、1µm程度



膜の支持体表面と緻密層表面の等倍率写真 図2

の孔径を有する窒化硅素膜であるが、3次元の網目構造 をした特徴のある形状をしている。図2は支持体表面と この緻密層とを等倍率で比較したSEM写真である。孔径 が大きく、したがって、透過抵抗の小さい支持体の表面 に、緻密ではあるが空隙率が大きい(80%以上)ために 透過抵抗の小さい薄膜をコーティングしたもので、支持 体を含めた膜全体の透過抵抗もきわめて小さなものと なっている³⁾. 図3は今回の濾過試験で主に用いた市販 のセラミック膜(孔径0.2 μ m)の表面構造とを比較したもので ある。膜の形状およびその空隙率に顕著な相違があり、 これが実際の濾過にあたってどのような効果を示すかを 以下に検討した。

3. 濾過試験装置

濾過試験装置のフローシートを図4に示した.実験は 外圧型10mmφのセラミックモジュールに対してクロス フロー方式で行った.使用したモジュールはアルミナ製 で公称孔径0.2μmの市販のもの(a),孔径15μmのアル ミナ製支持体(b)および支持体bの表面に静電成膜法で 窒化硅素膜をコーティングしたもので.ラテックス粒子 を用いた分画試験による孔径0.2μmのもの(c)の三種 類である.使用した溶質(粒子)は0.8μmのPMMA粒子





およびドライイースト(オリエンタル酵母社)で,後者 の場合は0.9%の食塩水にこれを分散させて使用した.濾 過試験に用いた水は,すべてイオン交換水を0.1µm孔径 のフィルターで濾過したものである.

濾過試験は操作圧力0.5kg/cm²以下,原液流速68cm/s, 液温25°C一定の条件下で行った.透過流束を回復させる ための膜の洗浄方法は、断続的に送液ポンプを停止する 方法²7およびこれに透過水による逆圧洗浄を併用する方 法で行ったが詳細は各図中に示した.なお、膜の溶質阻 止率については、膜の孔径に比べて溶質が十分に大き かったので測定しなかったが、支持体bの場合を除いて 透過液は透明であった.

4.実験結果および考察

4.1 膜の純水透過流束

図5は濾過試験に先立って、市販膜(a)支持体(b)お よび静電成膜による膜(c)について、同一条件下で純水 透過流束を測定し、これを比較したものである.この結 果から、支持体上に孔径0.2 μ m程度の緻密層を形成する ことによる透過流束の低下は、30%程度であることがわ かる.支持体の孔径15 μ mに対し、緻密層の孔径は0.2 μ m であり、実に75分の1と小さくなっている.しかるに、 透過流束の低下が小さいのは緻密層の空隙率が80%以上 ときわめて大きい上に、その厚さが20~30 μ mと薄いた めである.一方、これを同程度の孔径を有する市販膜(a) と透過流束について比較すると、静電成膜法により形成 された膜(c)のそれは約40倍であり、膜の透過抵抗がい かに小さいかがわかる.これは両者の膜の間に緻密層の 厚さと空隙率において大きな相違があるためである.

4.2 膜の濾過試験および洗浄試験

図6は図5に示した各膜の純水透過流束と同一条件の 下,0.8µmのPMMA粒子を0.1wt%溶液となるよう投入

し,その濾過試験および洗浄による膜性能の回復状況を

9

188 43巻4号(1991.4)

主 1

研 究 速 洗浄による膜の回復率

膜	使用前のPWF (<i>l</i> /m².hr)	使用後のPWF (l/m².hr)	回復率(%)
市販機 (a) 0.1kg/cm ²	403	202	50.1
支持体 (b) 0.05kg/cm ²	14879	12960	87.1
静電成膜(c) 0.05kg/cm ²	9612	9936	100



観察したものである。この濾過条件下では、きわめて短 時間(~3分程度)に透過流束が急激に減少し、その後 も減少が続き60分程度で定常的な透過流束になっている。 このときの透過流束は c 膜> b 膜> a 膜の順であるが、 各膜の間にはかなり大きな差がでている。これは原液の 濃度が薄いためにいまだ透過流束がケーク層律速になっ ていないためであると思われる。ここで注目される点の 一つは,膜の孔径が15µmであるb膜においても,0.8µm と小さな粒子に対して濾過能力を持つようになることで ある. これは良く知られているように, 粒子同志が架橋 し,自己阻止型のダイナミック膜を支持体表面に形成し, あるいは膜内に粒子が沈着することによるものであると 思われる.

つぎに、透過流束がおおむね定常に達した段階で、送 液ポンプを停止することによる洗浄方法(停止による負 圧を利用した逆圧洗浄)で、透過流束の回復を観察した ところ、 c 膜では運転再開後透過流束は著しく回復し、 しかも、透過液はきわめて透明なものであった。一方、 a, b膜でもある程度の透過流束の回復は認められたが, c 膜に比べると大きな差があった。b 膜では濾過中に粒 子の漏れが認められたが、特に運転再開時には濃厚な粒



子漏れがあり, 粒子が膜内に多量に沈着していたものと 思われた.

つぎに、濾過試験終了後に膜を取り出し、水道による 逆圧洗浄およびスポンジによる膜表面の洗浄を行った後 に純水の透過流束 (PWF)を測定し、濾過試験前のそれ とを比較し、洗浄効果を検討した。その結果を表1に示 した。この方法においてもこ膜の回復率は高く、洗浄し やすい膜構造であることがわかった。b膜では膜内への 粒子の沈着は比較的多いと思われるが、膜自体の透過抵 抗が小さいために、逆圧による洗浄効果がかなり有効に 働くものと推定される。一方、 a 膜の回復率が低いのは 緻密層の透過抵抗が大きいために, ケーク層のはく離に 働く有効圧力が減少し,洗浄効果が小さくなることが主 な原因であると考えられる。

図7は濾過圧力0.3kg/cm², PMMA粒子濃度0.3wt% とし,図6における操作条件に比べて濾過圧力,濃度と も高くし、このときのa、 c 膜の濾過性能および透過水 による逆圧洗浄の効果を比較したものである。b 膜は圧 力が高いため粒子の漏れが大きく,正しい濾過が行われ なかったので結果は省略した.この図から、この濾過条 件下では、運転開始後30~40分程度で透過流束が定常に なっており、ケーク層律速になることがわかる.そこで, 濾過開始後60分後にポンプを停止すると同時に透過水に よる0.08kg/cm²の逆圧洗浄を1分間行って,その洗浄効 果を検討した.図から明らかなように、a膜では洗浄効 果がほとんどないのに対して, c 膜では透過流束がほぼ 完全に戻っており、洗浄効果の大きいことがわかる。

これらの結果から、c膜は洗浄効果の大きい膜構造で

43巻4号(1991.4)

500

究 速 報





あることが明らかとなった。そこで、このc膜を用いて 濾過加圧4分間,ポンプ停止30秒の断続運転試験を試み た. その結果を図8に示した. なお, 濾過条件は図7と 同じである。時間と共に透過流束が若干低下してきてお り、ポンプの停止だけでは膜性能が完全には回復しない が、連続運転の場合に比べると高い透過流束が得られて いることがわかる。同様な実験をドライイースト(パン 酵母)を分散粒子として用いた試験を行い、a膜とc膜 の比較として示したのが図9である。C膜ではPMMA粒 子の場合と同じような洗浄結果が得られたが、a膜では 洗浄効果は不十分であった。

今回行った濾過および膜の洗浄試験の結果、洗浄によ

る膜性能の回復あるいは膜の洗浄を行いながら高い透過 流束を維持するのに適した膜の構造は,孔径が小さく, かつ、空隙率を大きくした透過抵抗の小さい膜であるこ とが改めて明らかとなった。それではなぜこのような膜 構造が洗浄性に優れているのであろうか. まず, 膜内部 への粒子の沈着は洗浄を著しく困難にする.したがって, これを防ぐには膜の孔径を粒子の大きさよりも十分に小 さくする必要がある。さまざまな大きさの粒子が含まれ ていることが予想される実液の処理では,膜の孔径はで きるだけ小さいものが望ましい。また、ケーク層と膜と の付着力は小さいほど洗浄しやすい。そのためには両者 の接触面積を小さくするのが有効な方法であり、膜表面 の空隙率を高めることはこの目的に合致することになる。 さらに、有力な洗浄方法の一つである逆圧洗浄方式を有 効に行うためには、逆圧がケーク層のはく離に十分生か されなければならない。そのためには膜全体の透過抵抗 を小さくする必要があり、膜の高空隙率化とその非対称 性(緻密層の薄膜化)が要求される。さらに、膜の透過 抵抗が小さければ濾過に当たって低圧操作が可能となり、 これはケーク層の密度を低下させるので洗浄しやすいこ とにもなる.

言 5.結

表面構造の異なる膜を使って,ケーク層の付着を伴う 濾過を行い,洗浄方法でファウリングにより劣化した膜 の性能回復を試みたところ、膜の表面構造の違いが洗浄 のしやすさに大きく影響することがわかった。また、膜 の洗浄を繰り返しながら高い透過流束を得るためには, できるだけ膜表面の孔径を小さくし、かつ、膜の空隙率 を高めて、膜全体の透過抵抗を小さくした非対称膜が適 していることが明らかとなった.

静電成膜法によって形成されたセラミック膜は、洗浄 性に優れた構造をしており、今後、再現性のある安定し た成膜条件が確立すれば、懸濁物質を含む溶液の濾過に 効果的な膜が実現できるものと期待している.

辞

濾過試験は東京大学工学部化学工学科木村研究室の装 置を借用して行った。ここに謝意を表します。 (1991年1月21日受理)

考 文 献

- 江藤ら:化工学会,第55年会要旨集 0310 (1990) 1)
- 2) 大谷ら:化工協会,第35年会要旨集 A106 (1988)
- 山本ら:生産研究,40(8)407(1988) 3)

謝

- 野村ら:化学工学シンポジウムシリーズ21 10 (1989) 4)
- 5) Yamamoto et al: J. Electrostatics 25 125 (1990)

1977